

(11) Publication number:

03

Generated Document.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(21) Application number: 02076092

(51) Intl. Cl.: G01B 11/00

(22) Application date: 26.03.90

(30) Priority:

(43) Date of application

publication:

05.12.91

(84) Designated contracting

states:

(71) Applicant: RIKAGAKU KENKYUS
ONO SOKKI CO LTD

(72) Inventor: OKAMOTO TAKAYUKI

YAMAGUCHI ICHIRO NAGAYAMA HIDENORI

(74) Representative:

(54) SPATIAL FILTER
DETECTOR AND
INSTRUMENT FOR
MEASURING
DISPLACEMENT
QUANTITY OF PATTERN
TRAVERSING
PHOTOSENSITIVE
ELEMENT

Best Available Copy

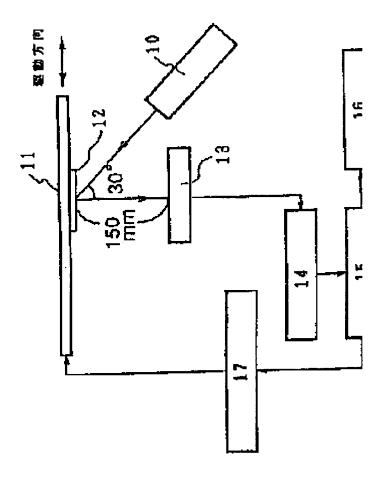
(57) Abstract:

PURPOSE: To perform measurement with high resolution by comparing signals with one another by changing the combination of the outputs of photosensitive elements arranged at equal spaces and adopting the signal with the largest amplitude.

CONSTITUTION: A laser beam emitted from an He-Ne laser light source 10 is incident on the surface of a rough surface object 12 mounted on a stepping motor carriage 11 to generate a speckle in diffused reflected light and received by a spatial filter detector 13. The detector

13 is constructed by changing the combination of connections between the outputs of photosensitive elements equally arranged at equal spaces. Since a speckle pattern moves with the displacement of the object 12, the movement quantity of the object 12 can be obtained by detecting the quantity of the movement of the speckle pattern. In a processing system, four kinds of differential outputs are taken in by an A/D converter 14 and processed by a computer 15. Obtained result are recorded by a plotter 16. Receiving signals from the computer 15, a stepping motor 17 is driven at a minimum 1 um/step.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio



① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-274401

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

國公開 平成3年(1991)12月5日

G 01 B 11/00

F 7625-2F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

○発明の名称 空間フイルタ検出器と受光素子を横断するパターンの変位量計測装置

②特 顧 平2-76092

20出 願 平2(1990)3月26日

特許法第30条第1項適用 1989年9月27日、社団法人応用物理学会発行の「1989年(平成元年)秋季 第50回応用物理学会学術講演会講演予稿集第3分冊」に発表

700発明者

岡本

隆之

秀徳

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

@発明者

山口一郎

埼玉県和光市広沢2番1号 理化学研究所内

@発明者 長山

東京都大田区矢口1-27-4 株式会社小野測器技術セン

ター内

创出 顯 人 理 化 学 研 究 所

埼玉県和光市広沢2番1号

⑪出 願 人 株式会社小野測器

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

@代理人 弁理士中村 稔 外7名

明 田 書

1.発明の名称 空間フィルタ検出器と受光素子

を横断するパターンの変位量計 御装置

2. 特許請求の範囲

- (2) 等間隔に配列した受光素子を備え、検出位置 に対する受光感度特性が、検出位置の増加につ れて周期的に変化する第1の特性、Asと、こ

の第1の特性の周期的変化と90度位相を異にして変化する第2の特性Acと、所定検出位置に至るまでは前記の第1の特性と同じように変化し、そして前記の所定検出位置を越えると位相を異にして変化する第3の特性Bsとは前記の第2の特性と同じように変化し、そして変化する第4の特性Bcとを含む空間フィルタ検出器、

この空間フィルタ検出器に接続され、前記の第1の特性Asの第1の出力信号を自乗する第2の自乗回路31、前記の第2の特性Acの第2の出力信号を自乗する第2の自乗回路31、前記の第3の特性Bsの第4の自乗回路37、

前記の第1と第2の自衆回路31、31′の 出力信号を加算する第1の加算回路、

前記の第3と第4の自乗回路37、37′の

出力信号を加算する第2の加算回路、

前記の第1と第2の加算回路の出力を比較し、 いずれの出力が大きいかを判別する比較判別回 路、

前記の第1の出力信号と前記の第2の出力信号との比を求める第1の割算回路、

前記の第3の出力信号と第4の出力信号との 比を求める第2の割算回路、

前記の第1の割算回路に接続された第1の逆 正接関数発生回路、

前記の第2の割算回路に接続された第2の逆 正接関数発生回路、

. 前記の第1の逆正接関数発生回路に接続された第1の遅延回路33、

前記の第2の逆正接関数発生回路に接続された第2の遅延回路33′、

前記の第1の逆正接関数発生回路と前記の第 1の遅延回路とに接続された第1の引算回路 35、

前記の第2の逆正接関数発生回路と前記の第

2 の遅延回路とに接続された第2の引算回路 3 5′、

前記の比較判別回路と前記の第1と第2の引 算回路35、35′に接続され、

このスイッチ回路に接続された累積回路36 を備えたことを特徴とする受光素子を横断するパターンの変位計測装置。

3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、非接触計測の分野に係わり、特に、 複数の受光素子組から成る空間フィルター検出器 を構成し、この検出器上に形成された被測定物体 の規則的または不規則的パターンの移動を検出し、 被測定物体の変位、速度、援動等を測定する適応 型空間フィルター検出器に関する。

(従来技術)

具体的には、被測定物体面に光を照射して形成されたパターン 7 0 の面上に受光素子 7 1 を配列して 2 組の櫛型検出器 7 2 、 7 3 を構成し、パターンの移動に伴うそれぞれの出力を差動増幅器 7 4 で増幅すると、同図 (B) に示すような出力信号が得られる。この信号の周期を数え、櫛のピッチをこれとかけ算してパターンの移動量が求められている。

(発明が解決しようとする課題)

しかし、上述した差動型空間フィルター検出器 別には適してが、例 えば、スペックルパターンの移動を検出するような場合 には、 空間フィルターで選択されるので、 空間フィルターで選択されるので、 この移動は 大き は ちたないパターン もあり得るので、 この移動とき 最 が できることがのの を 動方向 (符号) を 求める に とができなかった。 このため 物体の変位、 振動、

変形などを安定に測定できず測定の範囲も制約されていた。

本発明は、以上のような従来の空間フィルター 検出器の問題点に鑑みて、被測定物体面から生じ たランダムパターンが移動しても出力信号を消失 することなく、その速度、変位、振動等を高分解 能で測定する新型の空間フィルターを提供するこ とを目的とする。

(課題を解決するための手段)

上記の課題は、等間隔で配列された受光素子の出力間の接続の組み合わせを変えて複数の空間フィルター検出器を構成し、この複数の空間フィルター検出器から出力される各信号の振幅を比較し、そのうち振幅の最も大きい信号を採用することによって解決することができる。

また、前記空間フィルター検出器において、構成される各検出器上のパターンの移動により検出される正弦成分と余弦成分の信号を取り出し、その比の逆正接より出力信号の位相を求め、またその二乗和より出力信号の振幅を求め、次いで前記

ずれており、それぞれSFD1、SFD2のsin 成分とcos 成分を出力させる。またBS位相がまた Acには相から位相がまたれる。SFD2で中間相をする。 SFD2とで中間を M では、一方では、一方で消失した。 SFD1とSFD2の間では、一方では、 SFD1とSFD2とは、 SFD1とSFD1とSFD1ととは、 SFD1とSFD1とでする。 SFD1とSFD1とでする。 SFD1とSFD1とのはまれでうは、 SFD1とSFD1とを M でした。 SFD1との B を B でも できる。 C SFD1と SFD2の は S F D (1 + 2))を 抽出が できる。 C SFD(1 + 2))を 抽出が できる。 C SFD(1 + 2))を 抽出が できることを C S F D (回题を解決することを C S F D に C S F

第5図は、上記第3図中の感度分布図30の As、Acを演算処理して得られたSFD1の出力波形であり、同図(A)は物体変位-毎幅、同図(B)は、物体変位-位相図である。Asと AcはSFD1のsin 成分①とcos 成分②を出力しているので、それぞれの二乗和の平方からSFD1 振幅の最も大きい信号の位相増分を累積して前記 パターンの移動量及び移動方向を測定することに よって解決することができる。

(作用)

ここで、本発明の等間隔で配列された複数のスリット状の受光素子から成る出力間の接続の組み合わせを変えて4種類の差動出力を取り出した各受光感度について、第3図中の感度分布図30を用いて説明する。

Asは、従来の差動型空間フィルター検出器の 窓度分布を表している。正、負値に対応する2つの素子列を組み合わせて各受光素すことができる。本発明では、これを更にAc、Bs、Bcの3つの表発度では、これを更にTupを追出がある。を与える空間フィルタ理してパターと出力の 移動を高精度に検出する。まずAsとAcの出力の の場合わせをSFD2とする。AsとAc及びBs とBcの間はそれぞれ周波数応答の位相がエノ2

の振幅®及びそれぞれの比のarctanからSFD1の位相®が得られている。同図(A)で振幅が小さくなっている箇所(例えば物体変位が2.6~2.7 mm、3.7~3.8 mmの箇所)は検出器上のパターンに空間フィルター検出器で選択される空間周波数成分が消失しているからで、このときは同図(B)の位相も乱れている。

第6図は、第5図と同様にBsとBcを演算処理して得られたSFD2の出力波形である。第5図のSFD1の出力と第6図のSFD2の出力は検出といるにもカカとの出力が消失するときが一致したいない。このことによりSFD1及びSFD2を採用し、2.0m付近ではSFD1を採用する。

上記得られた出力信号の位相は検出器上のパターンの移動量を与える。ここで逐次SFD1と SPD2の2つの信号の振幅を比較し、大きい方 の位相増分を累積してその変化量を物体の移動量 に変換することにより物体の移動量を求めること ができる。更に、物体変位に対する位相の増減に よりパターンの移動方向を判別することができる。

本発明の検出器は、スリット状の受光素子の出 力間の接続の組み合わせを変えるだけで構成でき るので、従来の空間フィルター検出器と全く同じ 構造のものを使用できる。

(発明の効果)

以上祥述したように、本発明は受光素知識となる。に、本発明は受光素知識である。との得られた名ので、物体の移動に伴ううなないのがある。との得られた。というを採用するので、の移動に伴ううなないので、からはいから、はいりのでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないいのでは、ないでは、ないのでは、ないでは、ないのでは、ない

る。前記受光素子から成る検出器は一の μ m k が で 構成し、 構の υ ッチ 1 6 0 μ m は 数 3 2 本 とした。 ス 秒 動 世 を か で わ か 体 の 変 位 に 伴 って 移 動 世 を か で る た は 、 A s 、 A c 、 8 B s 、 8 B c の は か で きる。 処理系は、 A s 、 A c 、 8 B s 、 8 B c の は か で きる。 処理系は、 A c 、 8 C の ら み ら で 演算処理を 行 う。 そ に 記録する。 ほ な に で に 記録する。 また ら の 信 な ピューター 1 7 は コンピューター 5 を 受けて 最低 1 μ m / ス テップで 駆動する。

第2図は、第1図に示す本発明の空間フィルター検出器13の一例であり、受光素子の構成及び各素子からの出力間の接続部分を示す検出器の構成図である。受光素子の数は128本で検出器が第3図中の受光感度図30のAs、Ac、Bs、Bcとなるように接続している。第2図では、受光素子列(素子番号1~128)の中間(素子番号64と65の間、破線部分)から2つに分けて、それぞれの4つの素子、例えば素子番号1~4を

本発明の空間フィルター検出器は空間領域において、並列的に信号処理を行っているため、実時間測定ができる。またスペックルパターンを利用することにより物体の変位や変形量も知ることとがある。更に、検出器のピッチ以下の分解能なもって、必然素子間のピッチを細かくをもって、分解能はますます高くなり測定範囲も広くなる。従って、本発明の適応型空間フィルター検出器は、極めて産業上利用価値の高いものになった。

(実施例)

以下に、本発明の実施例を詳細に説明する。

第1図は、本発明を実施するための装置全体の 構成図である。He-Ne レーザー光源10から 被長が632.8nmで出射されたレーザービームを 面内方向に移動するスッテッピングモーター移動 台(10μm/ステップ)11に設置したアルミ 板の粗面物体12面上にスポット径0.6 mmで当て て、拡散反射光の中にスペックルを生じさせ、それを本発明の空間フィルター検出器13で受光す

第3図は、上記第2図の検出器で検出した信号 (As、Ac、Bs、Bc)の処理系を示すプロック図である。SFD1とSFD2の振幅を比較して大きい方の位相成分を累積する。AsのとAc②の信号をそれぞれ二乗器31、31′に入力し、2つの和をとることによりSFD1の振幅

特閒平3-274401(5)

③を求める。これと並行してAsのとAc②の比をである。これと並行してAsのとAc②の出た立正接関数発生回路32に入力的位相のを求める。位相は分を求める。位相増分を求める。では常にSFD2の位相増分が出力が行った。のは常にSFD2の位相増分が出力が行った。ここで比較器34でSFD2の振幅を下D2の振幅を下D2の振幅を下D2の振幅を取り出す。これを累積器36で累積して出力とする。時32回中の記号のへ④は第5図(A)の記号と対応して

第4図は、第2図の受光素子の構成から成る検出器を第1図に適用して検出器上のスペックルパターンの移動量を測定したものである。測定対象の粗面物体を10μm/ステップで、5m2往復移動させたときの測定値である。同図中の(SFD(1+2))が本発明による測定結果である。比較するためにSFD1、SFD2のみの場合の測

定結果も記録させた。図中のSFD1の信号消失 箇所a、SFD2の信号消失箇所bからわかるように、一方が測定できない場合もう一方で補っていることが(SFD(1+2))から理解がでいる。はかからは関定されているので関定はかから10秒体のときは位相が減少にいるのとので関定物体の移動である。ので関定が存むので関定ができる。の移動といるので関連を関するといるのでである。のででは、本発明の適定が行えることがわかった。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明を実施するための装置全体の 構成図、

第2図は、本発明の受光素子の配列及び各出力 間の接続を示す構成例、

第3図は本発明の第2図の検出器で検出した信号処理系を示すブロック図、

第4図は、粗面物体を用いて実施した本発明の

測定結果を示す位相図、

第5図(A)(B)は、感度分布As、Acの出力波形及びこれを演算処理して得られたSFD1の振幅及び位相の出力波形図、

第6図(A)(B)は、第5図(A)(B)と 同様にBs、Bcの出力波形及びこれを演算処理 して得られたSFD2の出力波形図、

第7図(A)(B)は、差動型空間フィルター 検出器の構成図及びその出力波形図である。

(符号の説明)

- 10 … レーザー光源、
- 11…ステッピングモーター移動台、
- 12…相面物体、13…空間フィルター検出器、
- 1 4 ··· A / D コンパータ、15 ··· コンピューター、
- 16…プロッター、17…ステッピングモーター、
- 30…感度分布図(空間フィルター検出器)、
- 31、31′、37、37′…二乗器、
- 32、32′…逆正接関数発生回路、
- 33、33′…遅延器、34…比較器、
- 35、35′…引算器、36 …累積器、

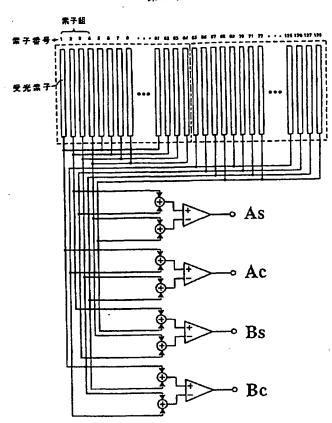
70…パターン、71…受光素子、

72、73… 櫛形空間フィルター検出器、

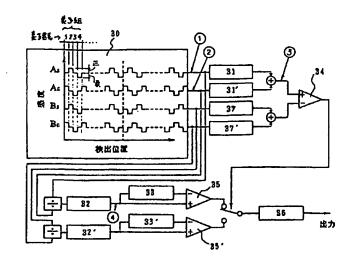
74…差動增幅器。

第2図

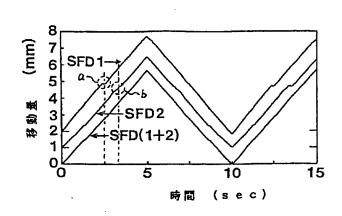
図面の存售(内容に変更なし) 第 1 図 150 30 12 配動方向 17 14 16

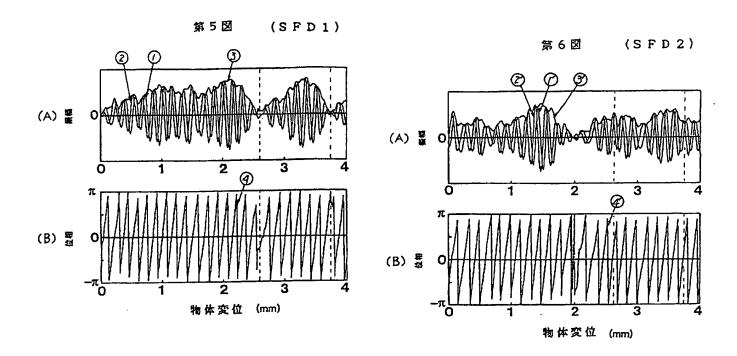


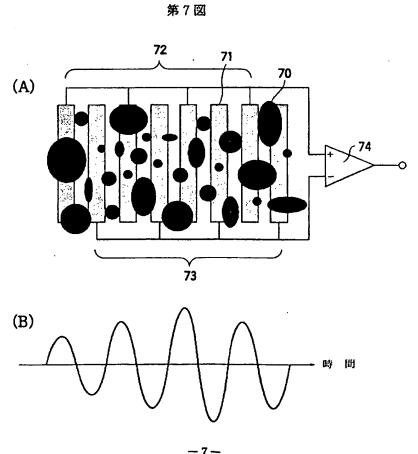
第3図



第4図







手 統 補 正 書 (方式)

平成 年 2. 10. 25

特許庁長官 植 松 敏 政

適

1.事件の表示

平成2年特許顯第76092号

2.発明の名称

空間 フィルタ 検出器と受光素子を 権断するパターンの変位量計測装置

3.補正をする者

事件との関係 出 戦 人

名称 (679) 理 化 学 研 究 所

. 4.代 理 人

住・所 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号

電話 (代) 211-8741

氏名 (5995) 弁理士 中 村

5.補正命令の日付 平成2年6月26日

6. 補正の対象

全図面

7 補正の内容

別紙のとおり

願者に最初に添付した図面の浄春 (内容に変更なし)

-8-

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
\square IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.